

【專家學者】

覺文郁，國立虎尾科技大學校長

〈簡介〉

● 最高學歷：

英國曼徹斯特大學 UMIST 機械製造研究所博士

● 研發專長領域：

精密機械/光學量測/系統整合

● 專利技術或研發成果

專利技術

已領證

1. 美國專利局專利核定發明第US 7,852,478 B1號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,許家銘；多軸工具機量測裝置。
2. 美國專利局專利核定發明第US 8,325,333 B2號；覺文郁,楊登宇,徐東暉；幾何誤差檢測裝置。
3. 美國專利局專利核定發明第US 8,111,405 B2號；覺文郁,劉建宏,王泓澍,陳博韋,楊俊嘉,蔡偉成,張維中,江明冀,陳嘉宏；鏟配件表面檢測及快速彩色記號標註裝置及方法。
4. 美國專利局專利核定發明第US 7,636,170 B1號；覺文郁,劉建宏；線性滑軌靜動態多功能測試機。
5. 美國專利局專利核定發明第US 7,773,234 B2號；覺文郁,劉建宏,李羿宗,謝東賢,徐東暉,王泓澍；一種五軸工具機檢測裝置。
6. 美國專利局專利核定發明第號US 8,116,902 B2;劉建宏,覺文郁,李羿宗;五軸工具機動態路徑檢測方法及其裝置。
7. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I390174號；劉建宏,覺文郁,游信和,黃偉銓,鄭仲翔,張皓雯,葉冠宏,劉忠侑；一種量測透明基板厚度與折射率之架構。
8. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I390198號；覺文郁,劉建宏,鄧雲峰,謝東賢,蔡承鴻,馮哲緒,陳欣政；一種線性摩擦阻力量測裝置。
9. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I388795號；覺文郁,楊登宇,徐東暉；幾何誤差檢測裝置。
10. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I388030號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,林玉山,段黎黎；一種應用分光束與動態感測器量測取放機構誤差之裝置。
11. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I385355號;覺文郁,劉建宏,段黎黎,黃學良,吳佳泰;導螺桿及螺帽牙型非接觸式量測方法及其裝置。



12. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I384196 號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,林玉山,枋仁傑,楊敏得,段黎黎；一種應用單光源於取放機構檢測X軸定位誤差與Y軸定位誤差之裝置。
13. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I383125號；覺文郁,劉建宏,王泓澍,吳家鴻,陳博韋,蔡偉成,張維中,李孟澤；應用雷射光源掃描鏟花表面的裝置與方法。
14. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I383466 號；覺文郁,劉建宏,陳宏光,謝東賢,鄧雲峰；一種壓印平台對準與調平的量測系統。
15. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I379732號；覺文郁,劉建宏,沈金鐘,林博正,吳家鴻,段黎黎,謝東賢,謝東興,陳怡靜,枋仁傑；兩段式長行程奈米級精密定位系統”。
16. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I379988 號；覺文郁,王泓澍,陳博韋,楊俊嘉,江明冀,蔡偉成,張維中,陳嘉宏；鏟配件表面檢測及自動化品質檢測裝置。
17. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I379989 號；覺文郁,王泓澍,陳博韋,楊俊嘉,江明冀,蔡偉成,張維中,陳嘉宏；具有取樣原點設定功能之掃描裝置。
18. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定新型第M443583 號；覺文郁,謝東賢,陳嘉宏,王彥傑,謝明松；刀塔式自動鏟花裝置。
19. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I378843號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,許家銘；多軸工具機量測裝置。
20. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定新型第M439537 號；覺文郁,黃學良,卓明震；工具機軌跡精度補償裝置。
21. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I372857號；覺文郁,劉建宏,謝東賢,鄧信豪,鄧雲峰,陳欣政,蔡承鴻；一種非接觸式振動量測裝置。
22. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I366660號；劉育君,覺文郁,陳俊仁；滾珠螺桿之哥德式螺紋接觸角測量方法。
23. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I361886號；覺文郁,劉建宏,鄧雲峰,謝東賢,蔡承鴻,馮哲緒,陳欣政；一種線性移動單元靜力矩量測裝置。
24. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I348537號；卓信鴻,覺文郁,林昌進,陳俊仁；光電式六自由度量測系統。
25. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I357470號；覺文郁,蔡穎堅,林博正,王泓澍,林忠民,李政男；高承載線性滑軌結構。
26. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I345624號；劉建宏 LIU, CHIEN HONG;覺文郁 JYWE, WEN YUH;葉憲昌；王智鵬；鄭舒壕；劉兆恒；林塏璋；趙晚君；鄭宗賢；一種應用於透明體與反射體間之平行量測裝置與方法。
27. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I340679號；覺文郁,劉建宏,李羿宗,謝東賢,徐東暉,楊登宇；一種五軸工具機檢測裝置。

28. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I326746號；覺文郁,劉建宏,謝東賢,鄧雲峰；線性滑軌行走平行度量測裝置。
29. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I326630號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,鄭友仁,李羿宗；一種檢測多軸加工機誤差之系統與方法。
30. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I323685號；卓信鴻,覺文郁,陳俊仁,李俊憲；一種用於三維空間定位性能檢測、三維循軌及任意軸直度量測之雷射陣列量測系統。
31. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I320480號；覺文郁,林昌進,陳俊仁,楊登宇,卓信鴻；一種繞射式六自由度光電量測系統。
32. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I320479號；卓信鴻,覺文郁,林昌進,陳俊仁,楊登宇；一種利用多重反射原理所建立的光電式六自由度量測系統。
33. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I320478號；覺文郁,林昌進,陳俊仁,李俊憲；一種二維光電式高精度角度量測系統。
34. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I318681號；劉建宏,覺文郁,方得華；姬梁文,李宗翰,葉憲昌；應用像散法於透明體與半透明體厚度檢測之系統。
35. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I315781號；曾憲中,覺文郁,劉建宏,方得華,王衍展；散熱座。
36. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I312730號；劉建宏,覺文郁,陳財源；陳睿宏,趙晚君,林塏璋,張智皓,劉兆恆,黃瀚興,鄭舒壕,鄭宗賢；全電式奈米壓印器。
37. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I302984號；劉建宏,覺文郁,方得華,梁文,陳朝貴；一種利用原子力顯微鏡為基台進行拉伸試驗的裝置與方法。
38. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I300733號；劉建宏,覺文郁,李羿宗；徐東暉,王泓澍,鄭友仁；一種奈米級三自由度微動平台機構。
39. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I292817號；劉建宏,覺文郁,方得華,梁文,陳朝貴,王智鵬,黃偉銓,陳昭帆,廖宗偉；非接觸式之雙向雷射探針。
40. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I292816號；劉建宏,覺文郁,謝奇辰,謝東賢,洪晨學,黃峻豪,徐東暉,方得華；一種檢測五自由度誤差系統。
41. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定新型第M324344號；邱毓英,覺文郁,劉建宏；伺服馬達背係消除機構。
42. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第M323050號；劉建宏,覺文郁,林文祥；奈米級旋轉軸誤差檢測系統。
43. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I290211號；劉建宏,覺文郁,方得華,梁文,陳朝貴,王智鵬,劉建平,王裕翔,陳揚東；高精度兩段式三角雷射共焦探頭。
44. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定新型第M321342號；覺文郁,劉建宏,邱毓英；對位機構。
45. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I287617號；劉建宏,覺文郁,李孟謙,徐東暉,方得華,鄭友仁；一種雙光束雷射干涉儀檢測直度誤差之系統與方法。

46. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I287616號；劉建宏,覺文郁,方得華,梁文,黃學良,吳星助,王泓澍；一種高精度奈米級旋轉軸誤差量測方法與裝置。
47. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I287614號；劉建宏,覺文郁,王智鵬,梁文,方得華；一種利用光學像散原理應用於自由曲面之量測系統與方法。
48. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I287613號；劉建宏,覺文郁,梁文,謝東賢,王泓澍,謝奇辰,徐東暉,方得華；雙軸六自由度振動量測系統。
49. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定新型第M319503號；覺文郁,劉建宏,邱毓英；四驅動對位對準平台。
50. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I285254號；劉建宏,覺文郁,鄧雲峰,邱昌田,王泓澍；一種高精度旋轉軸熱變形量測系統。
51. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I283736號；劉建宏,覺文郁,林益新,黃學良；利用貓眼反射器量測旋轉軸誤差裝置。
52. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I283616號；覺文郁,陳俊仁,陳裕傑,林益有；一種利用雷射及位置感測器所建立之鑽孔、攻牙量測裝置。
53. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I274140號；覺文郁,林昌進,陳俊仁,林冠宇,李俊憲,賴建名；一種利用繞射原理之光學式水平量測裝置。
54. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I274139號；劉建宏,覺文郁,謝奇辰,徐東暉；即時量測平台角度誤差之光學式量測單元及其方法。
55. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I271513號；覺文郁,劉建宏,謝東賢,謝奇辰；一種應用角隅稜鏡與四象限感測器建立奈米級解析度之三軸振動量測裝置。
56. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I270659號；覺文郁,林昌進,陳俊仁,賴建名,林冠宇,李俊憲；一種利用反射原理之光學式水平量測裝置。
57. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I263036號；覺文郁,陳俊仁；一種雙軸五自由度量測裝置與方法。
58. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I262117號；覺文郁,吳家鴻,徐錦衍,盧丙晏,邱仁志,蔡尚谷；微動機構。
59. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I261663號；覺文郁,陳俊仁；即時量測真圓度量測儀誤差之量測裝置及補償方法。
60. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I260394號；覺文郁,陳俊仁；一種奈米級旋轉軸誤差量測裝置。
61. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I249610號；覺文郁,陳俊仁,林民彰,莊哲豪；一種繞射式角定位多自由度量測裝置。
62. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I249609號；覺文郁,劉建宏,李龍添；一種繞射式角定位五自由度量測裝置。
63. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I247095號；覺文郁,劉建宏,林益新,李龍添；一種光學式旋轉軸誤差量測裝置。

64. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I245878號；覺文郁,劉建宏,黃學良；一種線性雙軸幾何誤差之量測裝置。
65. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I245877號；覺文郁,陳俊仁,陳裕傑,林益有；一種利用位置感測器平板所建立之工具機量測裝置。
66. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I243888號；覺文郁,劉建宏,陳朝貴,蔣仲智,孫堅哲,陳孟君,林宏鎰；繞射式三角雷射讀頭及其檢測誤差之方法。
67. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I243886號；覺文郁,陳俊仁,林民彰,莊哲豪；一種可檢測高速循軌性能裝置。
68. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I239385號；覺文郁,劉建宏,陳俊仁,連志瑋,劉建宏；一種穿透式光柵量測旋轉軸誤差之裝置。
69. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I238752號；覺文郁,吳家鴻,鄧雲峰；奈米級五軸共平面微動平台。
70. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I235233號；覺文郁,劉建宏,李浩瑋；微型主軸迴轉精度量測裝置。
71. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I235228號；覺文郁,林榮慶,劉建宏,周敬棠,陳俊仁；一種用光學尺量測技術結合原子力探針在二維平面量測的裝置。
72. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I232923號；覺文郁,劉建宏,徐承駿；單軸六自由度光學量測系統及方法。
73. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I231365號；覺文郁,劉建宏,周敬棠；使用四象儀與雷射二極體之三維振動位移量測系統。
74. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第M253596號；覺文郁,劉建宏,李龍添；一種奈米級六軸重載重之微動系統。
75. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I224188號；覺文郁,鄧雲峰；一種奈米級雙軸輪廓量測裝置。
76. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第I220688號；覺文郁,劉建宏,劉建宏,連志瑋；一種反射式光柵量測旋轉軸誤差裝置與方法。
77. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第205592號；覺文郁,詹國鑫,朱建興；一種負荷切削下數.工具機動態性能測試機構。
78. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第206083號；覺文郁,劉建宏,連志瑋,劉建宏；一種簡易的玻璃厚度的量測系統。
79. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第205945號；覺文郁,劉建宏,李龍添,林榮慶,蔡銘焜；可量測五自由度訊號系統。
80. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第202600號；覺文郁,劉建宏,李龍添；一種使用光柵式干涉儀之三維量測系統。
81. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第201880號；覺文郁,劉建宏,陳俊仁,陳朝貴；一種利用光柵繞射原理所建立之四自由度量測系統。

82. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第201878號；覺文郁,劉建宏,鄧雲峰,徐東暉,周敬棠,鄭凱安；一種以二維光學尺作六自由度量測的系統。
83. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第201877號；覺文郁,劉建宏,林榮慶,鄧雲峰,鄭凱安；一種五自由度環型光柵式旋轉軸量測系統。
84. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第201367號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,周敬棠,鄭凱安,鄧雲峰；一種利用平面光學尺檢測六自由度平台誤差的方法。
85. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第200206號；覺文郁；一種奈米級閉迴路四軸平台機構。
86. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第198700號；覺文郁,鄭東堯,陳健煌,劉俊昌,廖書仁；使用光槓桿原理檢測旋轉軸誤差之方法。
87. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第212275號；詹全安,覺文郁,賴子發；一種應用於線性編碼器的訊號傳輸裝置。
88. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第184594號；覺文郁,賴子發；一種簡易檢測數.工具機體積誤差之方法。
89. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第181557號；覺文郁,鄭東堯,陳健煌,劉俊昌,廖書仁；一種補償雷射二極體與四象儀量測系統之設定誤差的方法。
90. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第172294號；覺文郁,趙彥傑,謝明興；一種使用雷射二極體及四象儀檢測旋轉軸誤差之方法。
91. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第169667號；覺文郁 ,王永發；雷射內藏式量測連桿機構。
92. 中華民國經濟部智慧財產局專利核定發明第120289號；覺文郁 ,楊耀仁；微米級真圓度測量儀之偏心補正機構。

公告中

1. 中華民國經濟部智慧財產局專利公告第200918789號；陳仕岳,覺文郁,林博正；具軸徑差異型態之滾珠螺桿構造。
2. 中華民國經濟部智慧財產局專利公告第200914747號；覺文郁,劉建宏,邱毓英；線性滑動單元。
3. 中華民國經濟部智慧財產局專利公告第200804756號；劉建宏,覺文郁,謝奇辰,謝東賢,洪晨學,黃峻豪,徐東暉,方得華；一種檢測一維五自由度誤差系統。
4. 中華民國經濟部智慧財產局專利公告第200712457號；覺文郁 ,劉建宏,謝東賢,謝奇辰；一種應用角隅菱鏡與四象限感測器建立奈米級解析度之三軸振動量測裝置。
5. 中華民國經濟部智慧財產局專利公告第200636210號；覺文郁,林昌進,陳俊仁,賴建名,林冠宇,李俊憲；一種利用反射原理及繞射原理之光學式水平量測裝置。

公開中

1. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201142566號；覺文郁,沈金鐘,劉建宏,吳家鴻,盧群中,余英代；混合式六自由度奈米級精密定位平台系統。
2. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201124227號；覺文郁,蔡穎堅,林博正,李孟澤,王泓澍,謝東興,陳博韋,江明冀,陳嘉宏,黃金輝；自動化鏟花工件表面鏟花方法。
3. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201121700號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,許家銘；多軸工具機量測裝置。
4. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201120596號；劉建宏,覺文郁,李羿宗；五軸工具機動態路徑檢測方法及其裝置。
5. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201104214號；覺文郁,王泓澍,陳博韋,楊俊嘉,江明冀,蔡偉成,張維中,陳嘉宏；具有取樣原點設定功能之掃描裝置。
6. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201102612號；覺文郁,王泓澍,陳博韋,楊俊嘉,江明冀,蔡偉成,張維中,陳嘉宏；鏟配件表面檢測及快速彩色記號標註裝置及方法。
7. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201043920號；覺文郁,楊登宇,劉建宏,徐東暉,陳怡靜；雷射干涉儀檢測角度誤差之裝置與方法。
8. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201040682號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,林玉山,段黎黎；一種應用單光源檢測取放機構定位及角度誤差之裝置。
9. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201040503號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,林玉山,段黎黎；一種應用分光束檢測多自由度誤差裝置。
10. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201037729號；劉建宏,覺文郁,黃俊堯；直度誤差量測裝置。
11. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201025489號；覺文郁,劉建宏,陳宏光,謝東賢,鄧雲峰；一種壓印平台對準與調平的量測系統。
12. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201012607號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,林玉山,枋仁傑,楊敏得,段黎黎；一種應用動態感測器感測取放機構定位誤差之裝置。
13. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201009315號；覺文郁,劉建宏,鄧雲峰,謝東賢,蔡承鴻,馮哲緒,陳欣政；一種線性摩擦阻力量測裝置。
14. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201007120號；覺文郁,劉建宏,徐東暉,林玉山,枋仁傑,楊敏得,段黎黎；一種應用單光源於取放機構檢測雙軸誤差之裝置。
15. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第200938825號；覺文郁,劉建宏,謝東賢,鄧信豪,鄧雲峰,陳欣政,蔡承鴻；一種非接觸式振動量測裝置。
16. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第200938802號；劉建宏,覺文郁,梁文,方得華,李俊明；類比式位置感測器。
17. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第200832444號；邱毓英,劉建宏,覺文郁；四驅動對位對準機構。

18. 中華民國經濟部智慧財產局專利公開第201137306號；覺文郁,吳家鴻,陳怡靜,徐東暉,枋仁傑,楊登宇；光學式機台校正檢測裝置。

● 輔導產學合作經驗簡述

技術移轉

前技術移轉 16 家廠商共 34 件，技術轉移金共 3162 萬元台幣，並持續與多家廠商洽談技術轉移及合作事宜，近期將簽約。已技術轉移成果如下：

| 項次 | 技術名稱 | 專利名稱 | 授權單位 | 被授權單位 |
|----|---------------------------|---------------------------|----------|------------|
| 1 | 建立檢測高精度數值工具機之新光學尺量測系統 | 建立檢測高精度數值工具機之新光學尺量測系統 | 國立虎尾科技大學 | 新勁國際有限公司 |
| 2 | 精密數控工具機旋轉主軸誤差測量裝置之開發 | 精密數控工具機旋轉主軸誤差測量裝置之開發 | 國立虎尾科技大學 | 台同股份有限公司 |
| 3 | 一種使用雷射二極體及四象儀檢測旋轉軸誤差之方法 | 一種使用雷射二極體及四象儀檢測旋轉軸誤差之方法 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 4 | 雷射內藏式量測連桿機構 | 雷射內藏式量測連桿機構 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 5 | 一種使用光柵式干涉儀之三維量測系統 | 一種使用光柵式干涉儀之三維量測系統 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 6 | 微米級真圓度測量儀之偏心補正機構 | 微米級真圓度測量儀之偏心補正機構 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 7 | 一種補償雷射二極體及四象儀量測系統之設定誤差的方法 | 一種補償雷射二極體及四象儀量測系統之設定誤差的方法 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 8 | 一種簡易檢測數值工具機誤差之方法 | 一種簡易檢測數值工具機誤差之方法 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 9 | 一種利用平面光學尺檢測六自由度平台誤差的方法 | 一種利用平面光學尺檢測六自由度平台誤差的方法 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 10 | 一種奈米級閉迴路四軸平台機構 | 一種奈米級閉迴路四軸平台機構 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|----------|--------------|
| 11 | 光學式線性軸多自由度量測系統 | 一種利用光柵繞射原理所建立之四自由度量測系統 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 12 | 一種奈米級六軸載重微動系統 | 一種奈米級六軸載重微動系統 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 13 | 先期技轉 線性滑軌靜動態多功能測試機 (1/2) | 一種利用位置感測器平板所建立之工具機量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 14 | 可旋轉式多子模多轉刀伺服油壓沖床之高速進給系統與振動量測分析 | 一種應用單光源於取放機構檢測雙軸誤差之裝置 | 國立虎尾科技大學 | 台勵福股份有限公司 |
| 15 | 線性滑軌靜動態多功能測試機 (2/2) | 一種非接觸式振動量測裝置、雙軸六自由度震動檢測系統、一種應用角隅菱鏡與四象限感測器建立奈米級解析度之三軸振動量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 16 | 一種五軸工具機檢測裝置 | 一種五軸工具機檢測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 源台精密科技股份有限公司 |
| 17 | 應用雷射光源掃描鏟花表面的裝置與方法 | 應用雷射光源掃描鏟花表面的裝置與方法 | 國立虎尾科技大學 | 建德工業股份有限公司 |
| 18 | 應用雷射光源掃描鏟花表面的裝置與方法 | 應用雷射光源掃描鏟花表面的裝置與方法 | 國立虎尾科技大學 | 源台精密科技股份有限公司 |
| 19 | 先期技轉 創新高承載的鏟花型滑軌設計 | 高承載線性滑軌結構 | 國立虎尾科技大學 | 建德工業股份有限公司 |
| 20 | 滑塊尺寸檢測系統之介面 | 滑塊尺寸檢測系統之介面 | 國立虎尾科技大學 | 上銀科技股份有限公司 |

| | | | | |
|----|----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| 21 | 一種使用雷射干涉儀當做迴授控制技術 | 一種使用雷射干涉儀當做迴授控制技術 | 國立虎尾科技大學 | 源台精密科技股份有限公司 |
| 22 | 二自由度奈米級壓電對位平台機構 | 二自由度奈米級壓電對位平台機構 | 國立虎尾科技大學 | 羅翌科技股份有限公司 |
| 23 | 多軸工具機量測裝置 | 一種多軸工具機量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 亞崴機電股份有限公司 |
| 24 | 多軸工具機量測裝置 | 一種多軸工具機量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 發得科技工業股份有限公司 |
| 25 | 先期技轉：大型機具高精度光學式安裝校正系統開發(1) | 光學式機台校正檢測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 亞崴機電股份有限公司/台勵福股份有限公司/源台精密科技股份有限公司 |
| 26 | 先期技轉：大型機具高精度光學式安裝校正系統開發(2) | 光學式機台校正檢測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 亞崴機電股份有限公司/台勵福股份有限公司/源台精密科技股份有限公司 |
| 27 | 先期技轉：多軸工具機量測裝置 | 一種多軸工具機量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 財團法人精密機械研究發展中心 |
| 28 | 多軸工具機量測裝置 | 一種多軸工具機量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 東台精機股份有限公司 |
| 29 | 多軸工具機量測裝置 | 一種多軸工具機量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 大立機器工業股份有限公司 |
| 30 | 精密機具檢測、加工與應用技術 | 精密機具檢測、加工與應用技術 | 國立虎尾科技大學 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 31 | 一種三自由度量測技術 | 大型機具高精度光學式安裝校正系統 | 國立虎尾科技大學 | 豪篆微機電股份有限公司 |
| 32 | 多軸工具機檢測技術 | 一種多軸工具機量測裝置 | 國立虎尾科技大學 | 台灣麗馳科技股份有限公司 |
| 33 | 2D、3D 精度補償系統初期開發技術 | | 國立虎尾科技大學 | 智泰科技股份有限公司 |
| 34 | 精密機具幾何精度調校方法 | 精密機具幾何精度調校方法 | 國立虎尾科技大學 | 發得科技工業股份有限公司 |